

5 製造技術

# 高融点材料の単結晶育成技術と高密度単結晶材料

東北大学 金属材料研究所 准教授 横田 有為

2022年7月14日

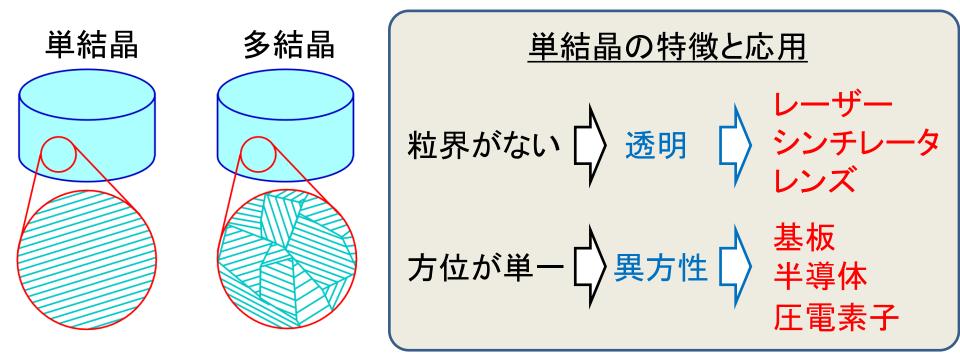
### 単結晶材料の特徴と応用展開

### 単結晶とは、

1つの固体が単一の結晶から成り立っているときに、その固体を単結晶と呼ぶ。(化学大辞典)

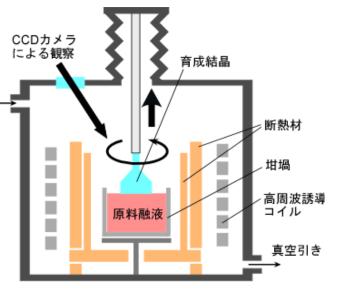
### 結晶とは、

固体であって、その内部構造が三次元的に構成原子(またはその 集団)の規則正しい繰り返しでできているものをいう。(化学大辞典)



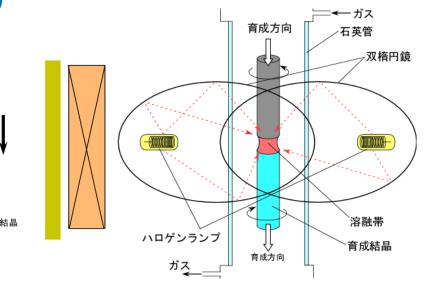
### 単結晶の育成手法(融液成長)

### チョクラルスキー法 (Czochralski[Cz]法)



ブリッジマン法 (Bridgman-Stockbarger [BS]法)





利点

欠

点

- 大型で高品質な 単結晶が作製可能 (量産化に利用)
- 遅い育成速度
- ・坩堝コストと反応性 への懸念
- 大型で高品質な 単結晶が作製可能 (量産化に利用)
- ・遅い育成速度

溶融原料

・坩堝コストと反応性 への懸念

- ・坩堝が不要
- 非調和溶融組成の 単結晶作製が可能
- ・高度な育成技術
- 大型化が困難
- ・原料棒の作製が必要

### μ-PD法による単結晶材料探索の特徴

多くの機能性単結晶の新規材料探索は 一部に限られてきた。

- ・育月
  - ・育成に必要なコストの高さ
  - ・育成に必要な期間の長さ
  - 育成技術の専門性

#### μ-PD法の結晶成長の効率性

従来法(Cz法やBS法)	μ-PD法
1~2週間	半日~1日
] [	

μ-PD法を利用した 機能性単結晶材料の大規模探索

圧電単結晶

Ca<sub>3</sub>Ta(Ga,Al)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub>

Ca<sub>3</sub>Nb(Ga,Al)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub>

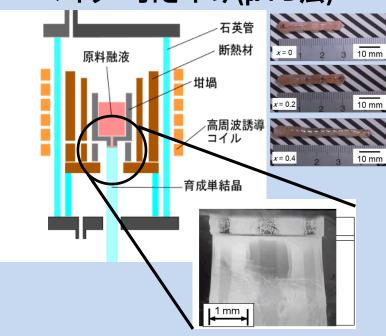


シンチレータ単結晶

Eu,Al:LiCaAlF<sub>6</sub>

Eu:Srl<sub>2</sub>

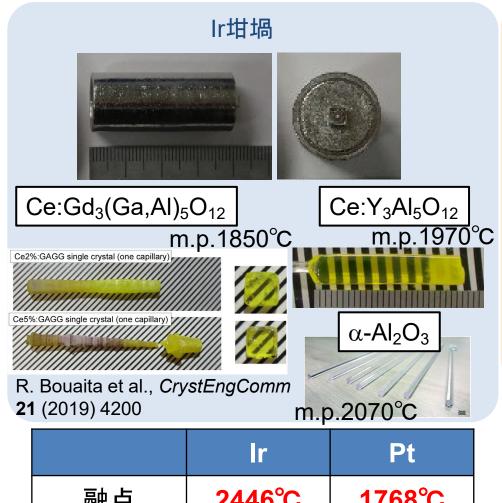
#### マイクロ引き下げ(μ-PD法)



- ・ 急峻な温度勾配
  - ➡高速結晶育成
- 形状制御結晶育成
  - ➡測定に最適な形状の結晶
- 材料に合わせて坩堝を選択可
- ・クラックフリー化が容易
- ・装置が比較的安価

### <mark>j説明会</mark> 従来のμ-PD法による酸化物単結晶材料探索

イリジウム(Ir)や白金(Pt)の坩堝を用いた従来のμ-PD法では様々な機能性 酸化物単結晶が作製されてきた。



	lr	Pt
融点	2446°C	1768°C
使用雰囲気	不活性	大気

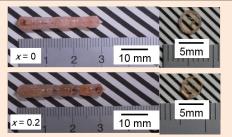
#### Pt坩堝





Ca<sub>3</sub>Ta(Ga,AI)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>14</sub>

Pr:SrTiO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>





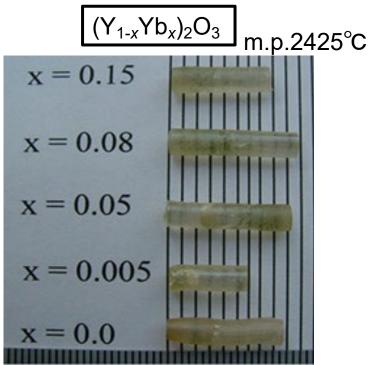
m.p.~1350°C

### 貴金属(Ir, Pt)坩堝の課題

- ・2100℃を超える融点を持つ材料系 には使用不可
- · Irの価格高騰 2,100円/g(2014)**中**20,433円/g(2022)

### <mark>説明会</mark> 従来のμ-PD法による酸化物単結晶材料探索

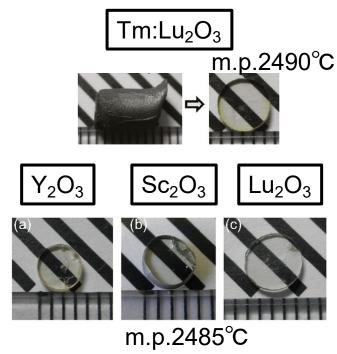
レニウム(Re)坩堝による高融点のセスキオキサイド( $RE_2O_3$ )単結晶作製が行われてきた。 RE:希土類(Rare-earth)



	Re
融点	3182°C
使用雰囲気	還元

A. Yoshikawa et al.,

B. Opt. Mater. 30 (2007) 6



A. Fukabori, Y. Yokota et al., *Opt. Mater.* **30** (2007) 6

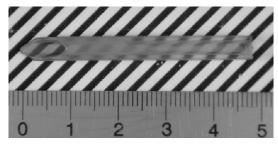
#### Re坩堝の課題

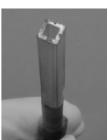
- ・坩堝が非常に高額
- ・適用範囲が狭い

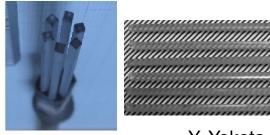
### <mark>説明会</mark> 従来のμ-PD法による酸化物単結晶材料探索

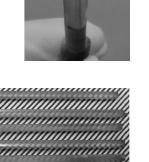
#### タングステン(W)およびモリブデン(Mo)坩堝によるサファイア単結晶作製

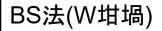
#### μ-PD法(Mo坩堝)













m.p.2070°C

- Y. Yokota, et al. J. Cryst. Growth 318(2011) 983
- C. Miyagawa, et al. J. Cryst. Growth 372 (2013) 95

	Мо	W
融点	<b>2620℃</b>	3422°C
使用雰囲気	還元	還元

#### W、Mo坩堝の課題

- ・坩堝の酸化を防ぐ必要性
- ・他の材料系での適用が少ない

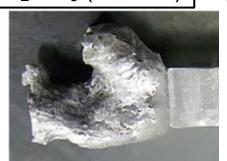
W、Mo坩堝も酸化物との反応性の高さが懸念されてきた。

### <del>技術説明会</del> 従来のμ-PD法による酸化物単結晶材料探索

#### 従来のMo、W坩堝の特徴

- MoやWは酸化物との反応性の高さや 育成結晶内の混入の可能性が指摘されてきた。
- MoやWの酸化を防ぐため、還元雰囲気下 (Ar+H<sub>2</sub>等)での育成が行われてきた。

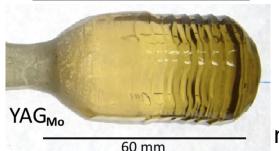
Ce:Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> (Mo坩堝) |m.p.2070℃



K. Kamada, et al., J. Cryst. Growth 535 (2020) 125510

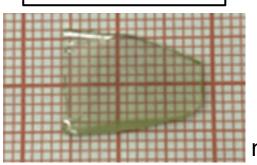
しかし、近年MoやW坩堝を用いた複合酸化物単結晶の作製に関して 報告されるようになってきた。

Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (Mo坩堝)



m.p.1970°C

GdScO<sub>3</sub> (W坩堝)



m.p.2127°C

S. Tkachenko, et al., *J. Cryst. Growth* **483** (2018) 195, K. Kamada, et al., *J. Cryst. Growth* **535** (2020) 125510

WやMo坩堝を用いることで高融点酸化物の単結晶育成が可能ではないか?



### ①育成条件の確立

坩堝 Mo坩堝 W坩堝

·雰囲気 還元雰囲気 Ar雰囲気

- 断熱材 処理なし 脱酸素処理

### ②高融点材料の育成

- La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> [LZO] 融点:2283℃

- La<sub>2</sub>Hf<sub>2</sub>O<sub>7</sub> [LHO] 融点:2418℃

酸化物	有効原子番号 Z <sub>eff</sub>	密度[g/cm³]	融点[℃]
La <sub>2</sub> Zr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	49	5.88	2283
La <sub>2</sub> Hf <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	64	7.86	2418
Lu <sub>2</sub> SiO <sub>5</sub>	66	7.32	2047
Gd <sub>2</sub> SiO <sub>5</sub>	59	6.61	1950
Bi <sub>4</sub> Ge <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	75	7.13	1050
Gd <sub>3</sub> Ga <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>12</sub>	54*	6.63	1850

### 育成プロセス

出発原料  $La_2O_3$ ,  $ZrO_2$ ,  $HfO_2$ ,  $Eu_2O_3$ 粉末 (> 3N) 仕込組成  $(La_{1-x}Eu_x)_2Zr_2O_7$ ,  $(La_{1-x}Eu_x)_2Hf_2O_7$ ; x=0, 0.01

#### μ-PD法による結晶育成

仕込組成で秤量・混合した原料粉末 を大気中1600°Cで仮焼

カーボン炉内でZrO₂断熱材を焼成 (@2000℃, Ar)[<mark>脱酸素化</mark>]

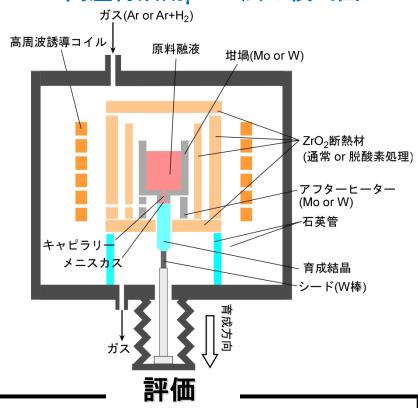
焼結粉末を入れたW(Mo)坩堝を 断熱材で覆い、融点以上に加熱

W棒により結晶を引き下げ

育成雰囲気: Ar+2%H<sub>2</sub> or Ar

育成速度 : 0.01 ~ 0.5 mm/min

#### 高温育成用<sub>μ</sub>-PD法の模式図



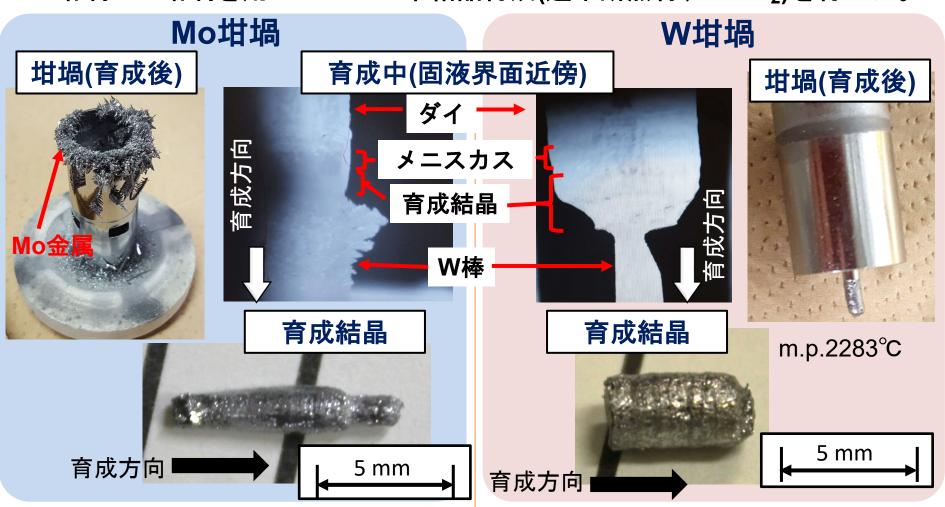
育成結晶の 大気アニール (1200℃12h)

結晶試料の 切断・研磨

- ·局所観察/組成分析(SEM/EDX)
- ·相同定(粉末XRD)
- ·結晶評価(背面反射Laue像·XRC)
- · 光学特性(透過率 · PL · XRL)

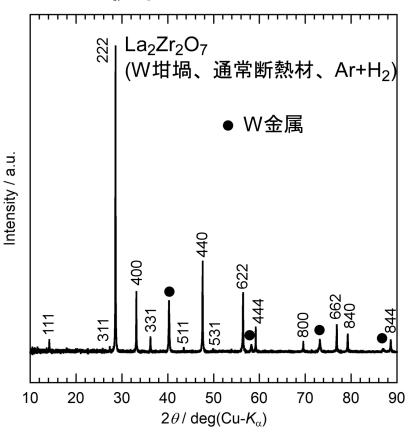
### 新技術説明会Mo坩堝とW坩堝を用いた結晶育成

Mo坩堝とW坩堝を用いてLZOの単結晶育成(通常断熱材、Ar+H₂)を行った。

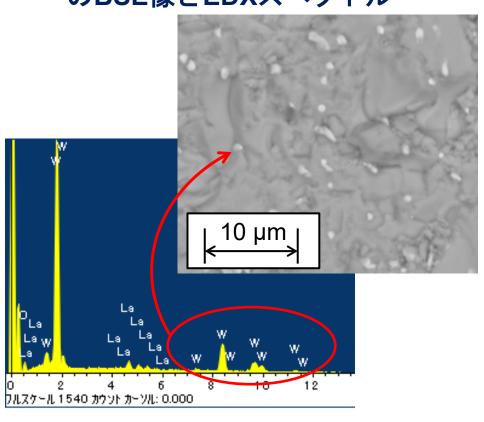


- 結晶育成には成功したものの、得られた結晶は不透明で黒色であった。
- ・Mo坩堝は結晶育成中に揮発したMoが坩堝上部に付着していた。
  - 一方で、W坩堝は結晶育成後も明確な劣化は生じなかった。

#### W坩堝で作製したLZO結晶 の粉末XRDパターン



#### W坩堝で作製したLZO結晶 のBSE像とEDXスペクトル

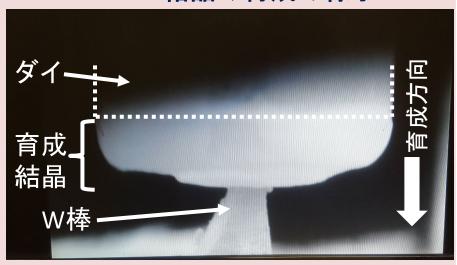


通常の断熱材とAr+H<sub>2</sub>雰囲気下において、W坩堝を用いて作製したLZO結晶には、W金属が混入していることが分かった。

### 断熱材の脱酸素処理



### W坩堝と脱酸素断熱材による LZO結晶の育成の様子



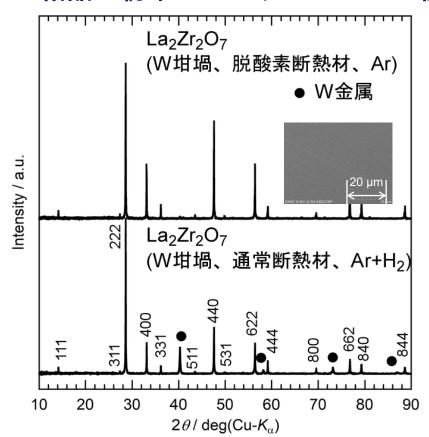
W坩堝と脱酸素断熱材で 作製したLZO結晶



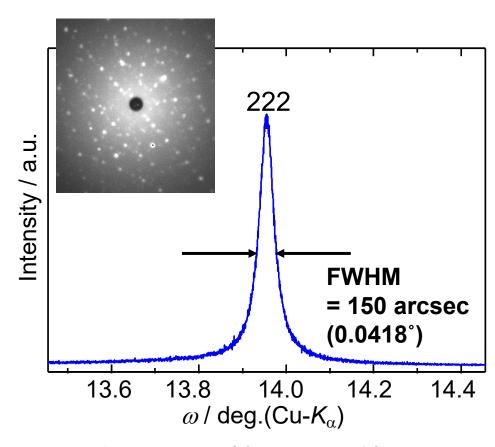
W坩堝と脱酸素処理した断熱材を用いて、安定した固液界面形状を維持しながら 結晶育成を行うことができた。

#### 新技術説明会 New Technology Presentation Meetings!

#### W坩堝と脱酸素断熱材で作製した LZO結晶の粉末XRDパターンとBSE像



### W坩堝と脱酸素断熱材で作製した LZO結晶のXRCと背面反射Laue像



脱酸素断熱材とAr雰囲気下において、W坩堝を用いて作製したLZO結晶は、

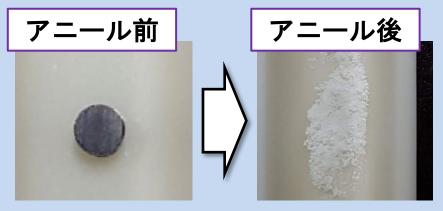
- W金属を含まないLZO単相
- ・明瞭なLaueパターン
- ・シャープな左右対称のX線ロッキングカーブ

を示した。

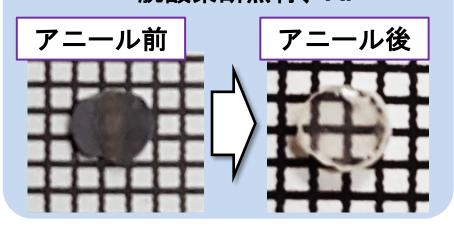
### LZO結晶のアニール効果と透過率

### LZO結晶のポストアニール (1200℃, 12h, 大気中)

通常断熱材、Ar+H<sub>2</sub>



#### 脱酸素断熱材、Ar



### LZO結晶の透過スペクトル 100 アニール前 300 400 800 **500** 600 700 Wavelength / nm

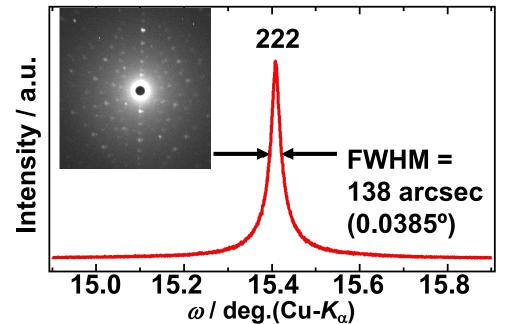
ポストアニールにより、 脱酸素断熱材とW坩堝で作製した LZO結晶は無色透明になった。

400 nm以上で70%以上の透過率





#### 育成したLHO結晶のXRCとLaue像



LZOと同様の育成条件により、

より高い融点のLHO(融点2418℃) も単結晶を育成

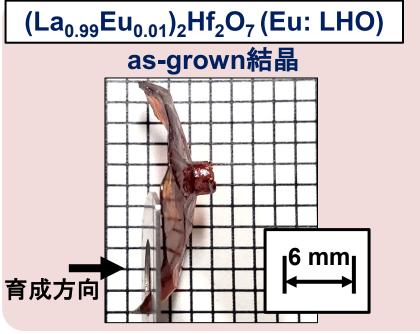
することができた。

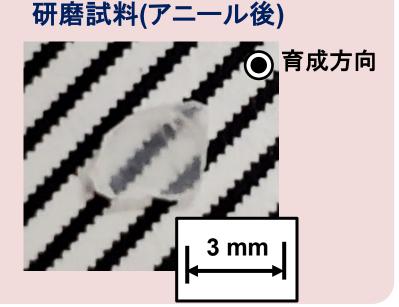


### Eu:LZOとEu:LHO単結晶の育成

無添加の結晶と同様の育成条件により、Euを添加した単結晶も育成した。

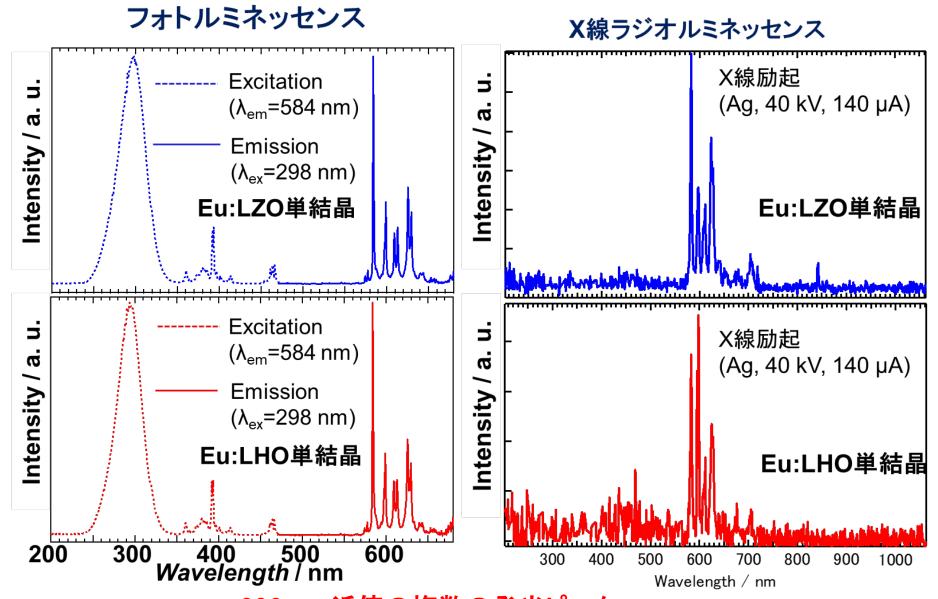








### Eu:LZOとEu:LHO単結晶の発光特性



**600 nm近傍の複数の発光ピーク** Eu<sup>3+</sup>イオンの4f-4f遷移に起因する発光



### 高融点酸化物の有効原子番号と密度

### 開発シンチレータ

酸化物	有効原子番号 Z <sub>eff</sub>	密度[g/cm³]	融点[℃]
La <sub>2</sub> Zr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	49	5.88	2283
La <sub>2</sub> Hf <sub>2</sub> O <sub>7</sub>	64	7.86	2418
Lu <sub>3</sub> TaO <sub>7</sub>	69	9.68	2380

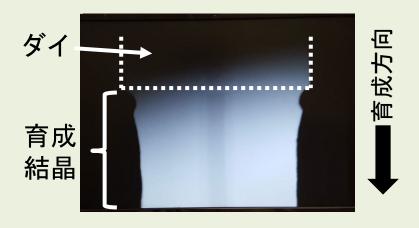
### 既存シンチレータ

PbWO <sub>4</sub>	76	8.28	1123
Lu <sub>2</sub> SiO <sub>5</sub>	66	7.32	2047
$Gd_2SiO_5$	59	6.61	1950
Bi <sub>4</sub> Ge <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	75	7.13	1050
$Gd_3Ga_3Al_2O_{12}$	54 <sup>*</sup>	6.63	1850

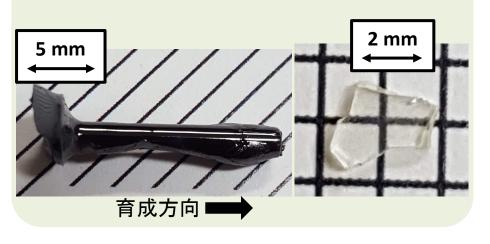


### Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>の結晶育成

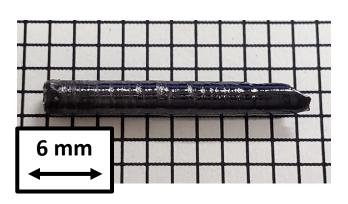
### W坩堝と脱酸素断熱材による Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>結晶の育成の様子

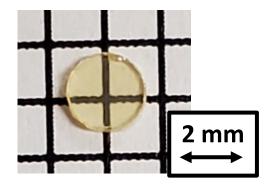


Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>単結晶



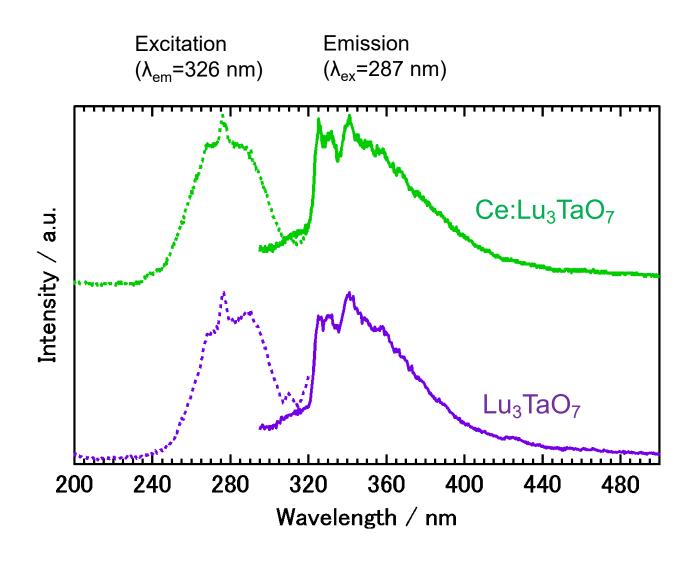
Ce添加Lu3TaO7結晶





### Ce:Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>と発光スペクトル

### 無添加およびCe添加Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>結晶のフォトルミネッセンススペクトル



ガス(Ar) 高周波誘導コイル 原料融液 W坩堝と脱酸素処理した断熱材 坩堝(W) を用いたμ-PD法によって 2100℃を超える融点を有する > ZrO。断熱材 (脱酸素処理) 複合酸化物の単結晶育成技術 を確立した。 石英管 脱酸素ZrO2断熱材 メニスカス 育成結晶 シード(W棒)

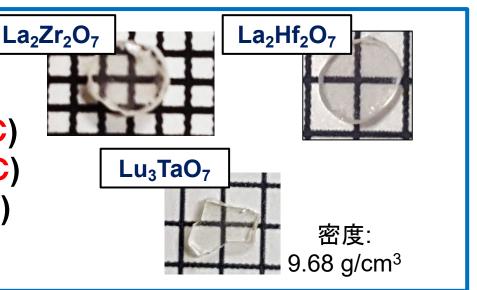
高融点用µ-PD法によって 高融点複合酸化物

La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (融点:2283℃)

La<sub>2</sub>Hf<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (融点: 2418℃)

Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub> (融点: 2380℃)

の単結晶を新たに開発した。



・世界最大の高密度(9.68 g/cm³)を有する シンチレータ単結晶として高エネルギー 放射線用の検出器に利用が可能である。

• 現在は $PbWO_4(8.2 \text{ g/cm}^3)$ が用いられている 高密度シンチレータ応用用途を置き換えること が可能である。

・シンチレータ以外にも、高密度を特徴とした透明な単結晶としての応用展開を期待している。

- ・ 現在、透明なLu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>単結晶の育成に成功して おり、発光中心元素の添加が可能であることを 示した。
- 今後、放射線励起下の発光特性(発光量、エネルギー分解能、蛍光寿命等)が優れた発光中心元素とその濃度を明らかにする。
- ・実用化に向けて、高融点酸化物単結晶のCz法による育成を実現し、最適な発光中心を添加した Lu<sub>3</sub>TaO<sub>7</sub>単結晶の大口径化を実現する。

- 未解決の発光中心の最適化については、現在 実施中であり1年以内の材料探索により克服でき ると考えている。
- ・シンチレータ単結晶を搭載した放射線検出器を 開発可能な企業との共同研究を希望する。
- また、Ir坩堝等を用いた機能性単結晶の量産化を 実施中、もしくは考えている企業には、本育成 技術の導入が有効と思われる。

・発明の名称:結晶材料、シンチレータ、

および放射線検出器

• 出願番号 : 特願2022-092879

出願人 : 東北大学

• 発明者 : 横田有為、須田貴裕、

堀合毅彦、吉野将生、

鎌田圭、吉川彰



## 本技術に関連する産学連携

 2020年12月 JST A-Step 産学共同(育成型)に採択 「高速結晶成長技術による高機能シンチレータ結晶 の大規模探索とデバイス化」

(研究責任者:横田有為)

\*東北大学のみで実施

• 2023年3月 JST A-Step終了予定



東北大学

産学連携機構 総合連携推進部

Website https://www.rpip.tohoku.ac.jp/jp/

TEL 022-795-5275

FAX 022-795-5286

E-mail souren@grp.tohoku.ac.jp